

# Альтами МЕТ ЗТ микроскоп для микроэлектроники

Альтами МЕТ ЗТ микроскоп для микроэлектроники

## Цена:

Цена по запросу

## Описание

Методы контрастирования в отраженном свете:	<ul style="list-style-type: none"><li>• светлое поле;</li><li>• темное поле;</li><li>• поляризация.</li></ul>
Увеличение (доступные значения):	50X-1600X (50X, 80X*, 100X, 160X*, 200X, 320X*, 400X, 500X, 600X*, 640X*, 800X, 960X*, 1000X, 1200X*, 1280X*, 1600X, 2000X*).
Окуляры:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WF10X/22 мм;</li><li>• WF10X/22 мм с перекрестием и шкалой (100 делений);</li><li>• WF16X/15 мм*;</li><li>• WF20X/12 мм.</li></ul>

Эпи-план ахроматические объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями, скорректированные «на бесконечность» (ICCOS L PLAN):

- PL L 5X/0.12 BD  $\infty/-$  (рабочее расстояние 9.7 мм);
- PL L 10X/0.25 BD  $\infty/0$  (р. р. 9.3 мм);
- PL L 20X/0.40 BD  $\infty/0$  (р. р. 7.2 мм);
- PL L 40X/0.60 BD  $\infty/0$  (р. р. 3.0 мм) (подпружиненный)\*;
- PL L 50X/0.70 BD  $\infty/0$  (р. р. 2.5 мм) (подпружиненный);
- PL L 60X/0.70 BD  $\infty/0$  (р. р. 1.9 мм) (подпружиненный)\*;
- PL L 80X/0.80 BD  $\infty/0$  (р. р. 1.2 мм) (подпружиненный);
- PL L 100X/0.85 BD  $\infty/0$  (р. р. 0.2 мм) (подпружиненный)\*.

Насадка:

- тринокулярная с наклоном 30°;
- отдельный выход для подключения устройств захвата изображения;
- диоптрийная подстройка  $\pm 5$  диоптрий;
- изменяемое межзрачковое расстояние 53-75 мм.

Освещение:	<ul style="list-style-type: none"><li>• система освещения Epi-Kohler с регулируемыми апертурной и полевой диафрагмами;</li><li>• колесо со светофильтрами (синий, зеленый, желтый, матовый);</li><li>• источник освещения галогенная лампа, 12 В/50 Вт;</li><li>• возможность комплектации LED осветителем для полупрозрачных объектов.</li></ul>
Предметный столик:	<ul style="list-style-type: none"><li>• прямоугольный двухкоординатный 280x270 мм;</li><li>• диапазон перемещений 204x204 мм.</li></ul>
Фокусировка:	<ul style="list-style-type: none"><li>• коаксиальные винты грубой и точной фокусировки;</li><li>• встроенный механизм для защиты объекта и объектива при быстрой смене;</li><li>• регулировка жесткости хода;</li><li>• шаг точной фокусировки 0.008 мм.</li></ul>

Цифровая камера:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• цветная CMOS 3 Мпикс (возможно укомплектовать другой камерой на выбор).</li> </ul>
Программное обеспечение:	<p>Altami Studio — программа для управления устройствами захвата изображения с возможностью проведения измерений, анализа и обработки изображений как на статичном изображении, так и на видеопотоке с камеры в онлайн-режиме.</p>

## Основные достоинства

- Предназначен для работы в отраженном свете, в светлом и темном поле, а также по методу простой поляризации
- Эпи-план ахроматические объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями, скорректированные «на бесконечность» (ICCOS L PLAN): 5X/0.17, 10X/0.25, 20X/0.40, 50X/0.70, 80X/0.8
- Большой удобный стол размерами 280×270 мм и диапазоном перемещений 204 x 204 мм — отличный инструмент для работы с кварцевыми пластинами, интегральными микросхемами и печатными платами больших размеров
- Возможность установки светодиодного осветителя для работы с полупрозрачными объектами
- Укомплектован цифровой камерой и программным обеспечением с функциями измерений объектов интереса, получения панорамного изображения и др